**Ивин, Владимир Владимирович. Исследование перспективных фотолитографических процессов с суб-0.2 мкм проектными нормами с помощью математического моделирования : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 05.27.01.- Москва, 2000.- 146 с.: ил. РГБ ОД, 61 01-1/294-4**